

TCカレッジ 令和5年度セミナー（技術・研究支援概論1） 第3回講演会（株式会社日立ハイテク）

顕微鏡観察装置の機能拡張 ～イメージングからデータ取得への取り組み～

◆◆◆ 講演概要 ◆◆◆

電子顕微鏡や走査プローブ顕微鏡は高い観察能力を有することから、産業から研究現場に至る幅広い分野で使用されています。近年はインフォマティクスを中心とした大量データの取得必要性などを背景に、それを支える自動データ取得や、実際に材料が使用されるのに近い環境下でのデータ取得など、電子顕微鏡などのイメージング装置にも観察能力以外の機能が求められつつあります。

株式会社日立ハイテクでは、これらのユーザー要望を踏まえた「大量データの自動取得」「異なる装置間での相関観察/分析」「環境制御/ダイナミック観察」などの技術に取り組まれています。

本セミナー講演会では、電子顕微鏡や走査プローブ顕微鏡及び試料前処理装置において、上記を実現する技術及び活用事例について紹介していただきます。

2023年11月14日（火） 9:00～10:30

ハイブリッド開催（東工大 大岡山キャンパス、zoom）

参加費無料

司会・進行：東京工業大学 オープンファシリティセンター
ファシリティステーション部門 古里 勇介

開会挨拶・TCカレッジの紹介（5分） 東京工業大学 TCカレッジ長 江端 新吾

講演 株式会社日立ハイテク CTソリューション開発部

1. 材料開発を支えるSEM技術

-前処理から大量データ取得まで- 技師 長岡 豊

2. 相関顕微鏡法の進展

-電子線・プローブ・光から得られる情報- 主任技師 相蘇 亨

3. 環境制御下での顕微観察技法

-全固体電池試料のTEM解析- 五十嵐 啓介



質疑応答（10分）

閉会挨拶（5分）

株式会社日立ハイテク CTシステム製品本部
主管技師 立花 繁明

参加方法

どなたでもご参加いただけます。
右のQRコードからご登録の上、
ご参加ください。



<https://www.ofc.titech.ac.jp/>

お問合せ先

東京工業大学オープンファシリティセンター
TCカレッジ事務局
tccoll-office@ofc.titech.ac.jp

主催：東京工業大学オープンファシリティセンター TCカレッジ 協力：株式会社日立ハイテク